

供媒體即時發佈

投資者關係：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 以全新測量系統擴充其 5D™ 圖案控制解決方案

綜合疊層對準和薄膜製程控制解決方案應對先進積體電路製程挑戰

【加州 MILPITAS 2015 年 2 月 19 日訊】今天，[KLA-Tencor Corporation](#)（納斯達克股票代碼：KLAC）推出兩款先進的量測設備，可支援 16 奈米(含)以下尺寸積體電路元件的研發和生產：Archer™ 500LCM 和 SpectraFilm™ LD10。Archer 500LCM overlay 測量設備在提升良率的所有階段提供了準確的 overlay error 回饋，可協助晶片製造商解決與 patterning 創新技術，例如 multi-patterning 和 spacer pitch splitting 相關的 overlay 問題。SpectraFilm LD10 薄膜測量設備則針對 FinFETs、3D NAND 和其他先進元件製程中的薄膜層，進行穩定可靠的厚度與應力的驗證和監控。新設備為 KLA-Tencor 獨一無二的 [5D™ Patterning Control Solution](#) 的關鍵產品，可透過對半導體廠整廠製程的表徵和監控來推動最佳化 patterning 結果。

KLA-Tencor Parametric Solution Group 副總裁 Ahmad Khan 表示：「身為光學測量的業界領先公司，我們與客戶密切協作，以瞭解他們在 patterning overlay 最佳化、critical dimension 和薄膜品質方面遇到的挑戰。在晶圓代工、邏輯電路和記憶體晶片製造，我們的客戶需要具備生產能力的測量設備，用以產生闡釋複雜製程問題所需的關鍵資料。全功能測量設備，例如我們全新的 Archer 500LCM 和 SpectraFilm LD10 平台，採用了多種創新，在多種應用中提供測量的靈活性，從而有助於我們的客戶改善現有技術節點良率，進而對未來技術節點進行分析探討。」

Archer 500LCM overlay 測量設備採用成像測量技術及獨一無二的基於雷射散射測量技術，提供廣泛的測量選項，並支援各式各樣的 overlay target 設計，例如 in-die、small pitch 或 multi-layer target，這種靈活性能夠經濟高效地產生精準的 overlay error 資料，可用於進行曝光機的校正或產線異常的辨識，協助工程師判斷何時對晶圓進行重新加工或者調整製程，以滿足嚴格的 patterning 要求。多個 Archer 500 LCM 設備已在全球的代工廠、邏輯電路製造商和記憶體製造商中使用，可提供獨一的 overlay 性能，以用於先進研發和大量生產上。

SpectraFilm LD10 引用了獨特雷射驅動的電漿光源，可針對各類薄膜層進行穩定高精度的薄膜測量，包括用於形成 FinFET 等複雜的元件結構的極薄多層薄膜層。3D NAND 快閃記憶體裝置中的薄膜層具有厚且多層的特點，則使用了全新的紅外線光學系統。與上世代的 Aleris® 平台相比，SpectraFilm LD10 的量測速度大幅增加，不僅擁有高產能，而且還能檢驗和監控

與 multi-patterning 及其他領先製造方法相關的更多薄膜層。 SpectraFilm LD10 已接獲多個訂單，用於先進的積體電路研發和生產。

Archer 500LCM 和 SpectraFilm LD10 系統,再加上 [SpectraShape™ 9000](#) 關鍵尺寸和裝置輪廓測量平台、[K-T Analyzer®](#) 先進資料分析系統，以及其他眾多製程控制系統，可支援 KLA-Tencor 的綜合 5D Patterning Control Solution。為了保持高性能和高產能，滿足最先進的積體電路生產需要，Archer 500LCM 和 SpectraFilm LD10 系統由 [KLA-Tencor 的全球綜合服務網路](#)提供支援。關於更多資訊，請參閱 [5D Patterning Control Solution 網頁](#)。

關於 KLA-Tencor：

KLA-Tencor 公司是製程控管與良率管理解決方案的領先供應商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、發光二極體 (LED) 及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，超過三十五年一直為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州米爾皮塔斯 (Milpitas)，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 <http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)。

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 Archer 500LCM 與 SpectraFilm LD10 設備及 5D Patterning Control Solution 的預期效能，Archer 500LCM 與 SpectraFilm LD10 設備及 5D Patterning Control Solution 相對於未來技術節點的可延續性，半導體產業的趨勢及其帶來的預期挑戰，KLA-Tencor 的客戶對 Archer 500LCM 與 SpectraFilm LD10 設備以及 5D Patterning Control Solution 的預期使用，以及 Archer 500LCM 與 SpectraFilm LD10 設備及 5D Patterning Control Solution 使用者可以實現的預期成本、營運與其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題），其他公司推出競爭性產品，或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###